

ICS 71.040.99
CCS N 53



中华人民共和国国家标准

GB/T 20724—2021

代替 GB/T 20724—2006

微束分析 薄晶体厚度的 会聚束电子衍射测定方法

Microbeam analysis—Method of thickness measurement for thin crystals
by convergent beam electron diffraction

2021-12-31 发布

2022-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 方法概述	3
5 仪器设备	4
5.1 主要设备	4
5.2 数据的记录与测量方式	4
6 试样	4
6.1 一般要求	4
6.2 薄晶体试样	4
6.3 萃取复型或粉末试样	4
7 实验步骤	4
7.1 仪器准备	4
7.2 获取双束会聚束电子衍射花样	5
7.3 数据测量与计算	6
8 测定结果的不确定度	7
9 实验报告	8
附录 A (资料性) 硅薄晶体厚度的会聚束电子衍射技术测定示例	9
A.1 试样	9
A.2 实验条件及参数	9
A.3 实验结果与数据分析	9
A.4 测量结果	15
参考文献	16